(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 9 月 12 日(12.09.2014)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2014/136557 A1

(51) 国際特許分類:
F16K 27/00 (2006.01) *G05D 7/06* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/053609

(22) 国際出願日: 2014 年 2 月 17 日(17.02.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2013-046867 2013 年 3 月 8 日(08.03.2013) JP

(71) 出願人: 株式会社フジキン(FUJIKIN INCORPORATED) [JP/JP]; 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番２号 Osaka (JP).

(72) 発明者: 横田　淳(YOKOTA, Jun); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番２号　株式会社フジキン内 Osaka (JP). 吉田　貴洋(YOSHIDA, Takahiro); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番２号　株式会社フジキン内 Osaka (JP). グエン　タイン　トゥン(NGUYEN, Thanh Tung); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番２号　株式会社フジキン内 Osaka (JP). 松田　隆博(MATSUDA, Takahiro); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番２号　株式会社フジキン内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 渡邉　彰，外(WATANABE, Akira et al.); 〒5420086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目１３番１８号　イナバビル３階　キシモト特許事務所内 Osaka (JP).

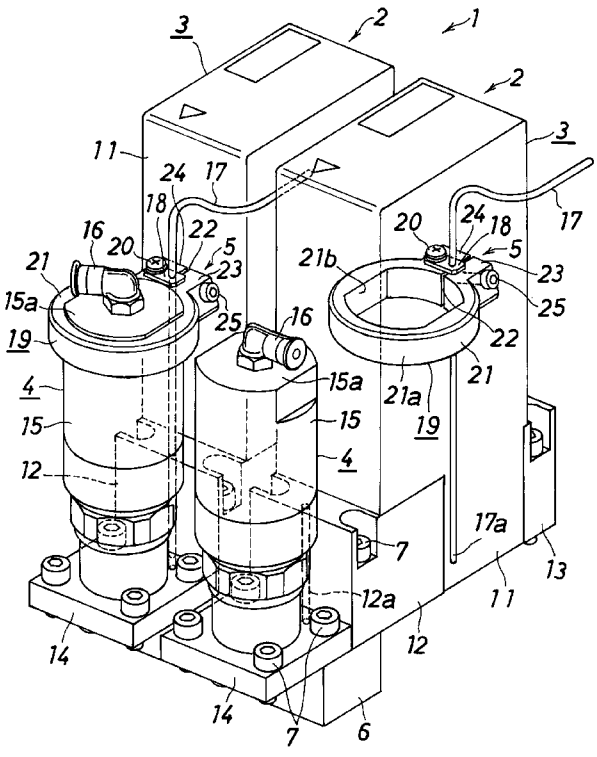
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) **Title**: FLUID CONTROL DEVICE AND STRUCTURE FOR INSTALLING THERMAL SENSOR AT FLUID CONTROL DEVICE

(54) 発明の名称 : 流体制御装置および流体制御装置へのサーマルセンサ設置構造



(57) **Abstract**: Provided are: a fluid control device that effectively uses the space of a fluid control device and can install a thermal sensor for temperature management by means of a simple installation; and a structure for installing the thermal sensor at the fluid control device. The fluid control device (1) is provided with: a first fluid control apparatus (3) and second fluid control apparatus (4) that are adjacent to each other; and a thermal sensor (17) that measures the temperature of a fluid flowing within the first fluid control apparatus (3). The fluid control device (1) is further provided with a support member (19) that supports the thermal sensor (17) and is attached to the second fluid control apparatus (4).

(57) 要約:　流体制御装置にあるスペースを効果的に使用して、簡単な施工で温度管理のためのサーマルセンサを設置することができる流体制御装置および流体制御装置へのサーマルセンサ設置構造を提供する。　流体制御装置 1 は、互いに隣り合う第１の流体制御機器 3 および第２の流体制御機器 4 と、第１の流体制御機器 3 内を流れる流体の温度を測定するサーマルセンサ 17 とを備えている。流体制御装置 1 は、第２の流体制御機器 4 に取り付けられてサーマルセンサ 17 を支持する支持部材 19 をさらに備えている。

WO 2014/136557 A1

NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）